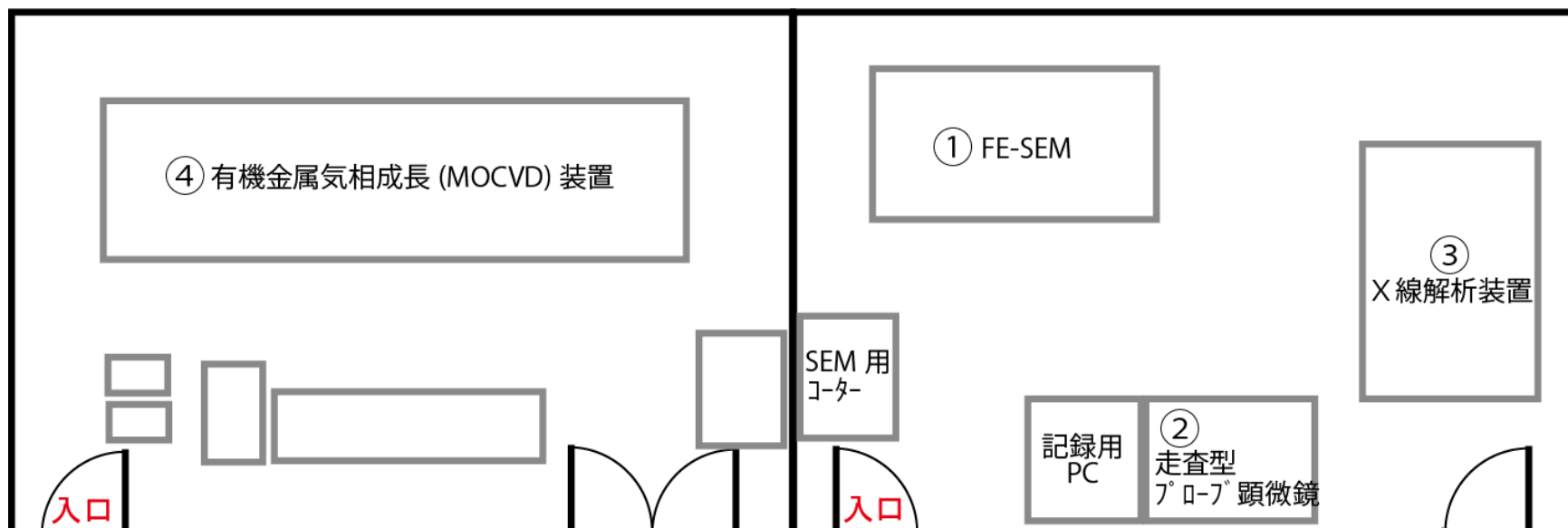


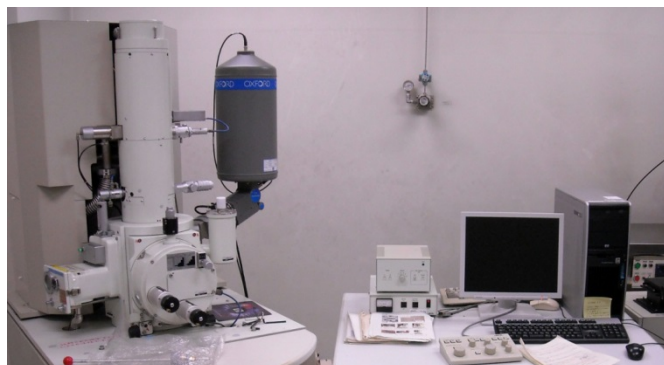
電子・光材料 成膜・分析・評価設備

(2F 202号室、206号室)



202号室 & 206号室内設備配置

①FE-SEM



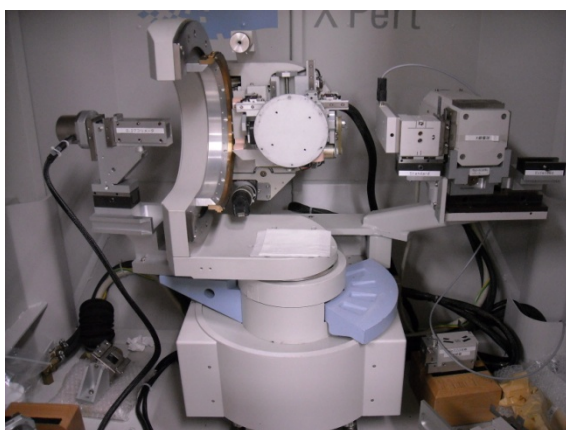
電界放射型の走査型電子顕微鏡で、数nmの観察が可能です。EDSが備わっており元素の分析ができます。反射電子の測定が可能で、元素の違いや凹凸を明確にすることができます。

②走査型プローブ顕微鏡



大気中でのAFM、STM、コンタクトAFM、ケルビンプローブなどの顕微鏡機能でナノ材料評価に適します。

③X線回折装置



結晶格子の評価をする装置です。 ω - 2θ ロッキングカーブ、逆格子空間の測定が可能です。結晶の組成、欠陥の評価に加え、超格子構造、ナノ結晶の評価も可能です。

④MOCVD装置(GaN系)



青色発光ダイオードを代表とするGaN系の半導体薄膜を成膜する装置です。大気圧と減圧、両方の条件での成膜が可能です。